

## SEMICON® Japan 2023 出展ご案内

拝啓 時下益々ご清栄の段お喜び申し上げます。毎々格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  
さて、本年も 47 年目となる SEMICON® Japan2023 に出展することになりました。

本年は 2022 年に唯一国内製造イオン注入ガスソースの提供 (Made in Japan) を開始し日本国内の半導体工場のお客様にご使用をいただいております、独自の技術を使った負圧型イオンソースガス「T-ion™」と「エキシマレーザーガス」を中心に紹介いたします。是非、当社ブースにお越し下さい。(前工程ゾーン 小間番号 2519)

尚、新たな試みとして、T-ion™ 容器を最新型インプラガスボックスに実際セットした状態での展示をいたします。

これにより、現在 SDS 等をご使用のお客様におかれましても、切り替え時のイメージをわかりやすく認識していただき且つ、あらたな展開のご提案もさせていただけるものと考えております。

また当社ブースではハッピーアワーを開催いたします。(※開催日時: 12月14(木)16~17時)  
今年も貴社のお役に立てるよう深い情報交換をさせて頂きたいと存じます。

昨年以上に充実した内容となるようスタッフ一同努めて参りますので、ご多用中とは存じますが、皆様方のご来場をお待ちしております。

敬具

### 記

1. 開催場所 東京ビッグサイト 東展示場 2 ホール (Super THEATER ステージ裏)
2. 開催日 2023 年 12 月 13 日 (水) ~ 12 月 15 日 (金)
3. 展示時間 午前 10 時 ~ 午後 5 時
4. 弊社出展ブース 前工程ゾーン 小間番号 2519
5. 展示製品

### ○注目製品

- ◆ 吸着型負圧ガスイオンソース T-ion™
- ◆ エキシマレーザー発振用ガス (ArF、KrF 用等)
- ◆ トクシキャプチャー™ (毒性ガスを無害化するアウトレットキャップ)
- ◆ <sup>11</sup>BF<sub>3</sub>(11 エンリッチボロン)
- ◆ <sup>72</sup>GeF<sub>4</sub>(72 エンリッチ四フッ化ゲルマン)
- ◆ 最先端半導体エッチング、クリーニング用フロン系ガス

以上